



光波動場三次元顯微鏡

MINUK

眞實を見抜く。未来をはかる。

Features

n m等級的透明異物・缺陷量測評價

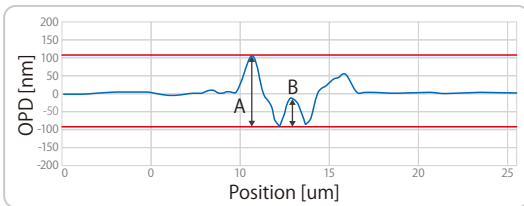
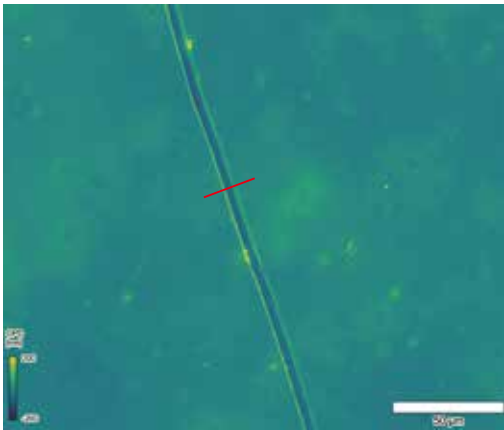
1次取樣瞬間取得深度方向的情報

無需對焦即可高速量測

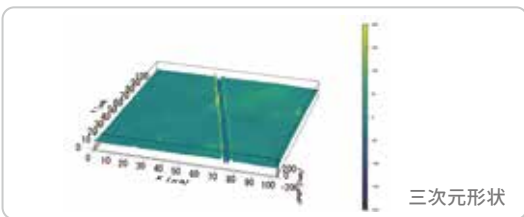
非破壞・非接觸・非侵入式量測

輕鬆掃描量測面內任意位置深度

■ 將肉眼不可見的透明薄膜表面可視化・定量化

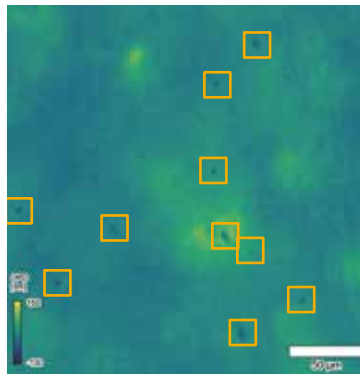


<<Height>> Point A: about 200nm, Point B: about 100nm



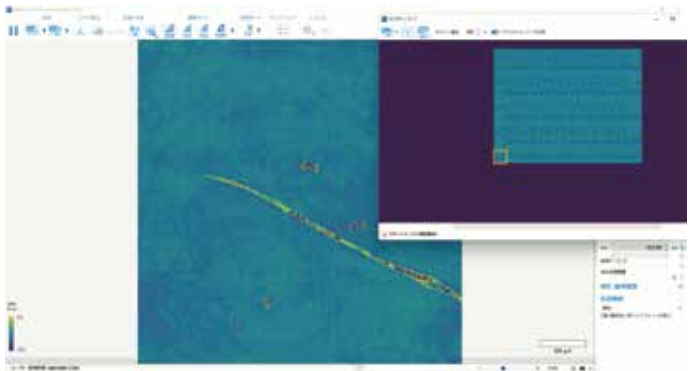
以非接觸・非破壞・非侵入方式取得nm奈米等級的形狀情報。一次取樣即可取得深度方向的所有情報。將肉眼不可見的透明薄膜表面的傷痕・缺陷等橫切面形狀數值化。

■ 觀察透明薄膜內部的填充物



肉眼不可見的透明薄膜內部的添加物。由一次取樣即可觀察。量測後可自由改變深度方項。識別各個深度的填充物。

■ 任意面內高速掃描量測決定觀查位置



拼接(Stitching)功能讓您快速繪製大範圍並獲取訊息。讓您快速找到想要觀察的地方並獲取詳細資訊。

解析度 (x,y)	691nm (One shot)、488nm (合成)
視野 (x,y)	700 x 700 um
分解能 (z)	10 nm (位相差)
視野 (x,y)	±700 um
樣品大小 (x,y,t)	100 x 80 x 20 mm (使用標準樣品架時)
樣品台 (x,y)	精細X-Y Auto Stage: X ±10 mm, Y ±10 mm 粗階段: X 129 mm, Y 85 mm

光源	波長 638nm 功率 0.39nW以下 Class1 (被測樣品的照射強度)
尺寸 (WxDxH)	本體: 505 (W) × 630 (D) × 439 (H) ±20mm (PC、附屬品尺寸除外)
重量	41 kg
消費電力	本體: 290 VA (PC、附屬品除外)

- 本公司保有型錄中產品外觀、規格改良更新之權利。為改良之便，有可能不經預告，變更記載產品的外觀與規格。
- 公司名稱與商品名稱均為各公司之註冊商標。
- 嚴禁任意轉載本型錄所記載的部分或所有內容。

2023.10.25-23.09.06

大塚科技股份有限公司

- (台北) 台北市中山區松江路237號4樓
Tel.(02)2515-3066 Fax.(02)2515-3069
- (台南) 台南市中西區永福路一段189號7F D2室
Tel.(06)215-1970 Fax.(06)215-1971



<https://otsuka-tw.com/>